

## 1st Nano-Micro Fabrication Symposium (NMFS2022), 微細パターン形成に関するシンポジウム

日程：9月7日(水)～9日(金)

主催：Nano-Micro Fabrication Symposium 実行委員会

共催：東北大学マイクロシステム融合研究開発センター、MEMS パークコンソーシアム

場所：東北大学環境科学研究科本館/西澤潤一記念研究センター

参加費：無料

詳細：<http://www.mu-sic.tohoku.ac.jp/NMFS/>

問い合わせ先：NMFS 実行委員会事務局 [nmfs-office@mail.mu-sic.tohoku.ac.jp](mailto:nmfs-office@mail.mu-sic.tohoku.ac.jp)

半導体加工技術を応用して微細パターンを形成するナノマイクロファブ리케이션は、半導体のみならずセンサや微小光学部品などの幅広いデバイス作製に

欠かせない技術です。その要であるリソグラフィ技術のほか、エッチング、成膜、インプリント、めっきなど、様々な技術が複合的に用いられますが、加工装置や

計測装置の進歩により、その応用範囲が拡大しています。本シンポジウムでは、デバイス分野の研究開発を加速させることを目的として、最新の加工装置や

計測装置で可能となるナノマイクロファブ리케이션に関する講演とハンズオンの実習を行います。

### 【プログラム】

9月7日(水) Seminar [環境科学研究科本館](#) 講演：2階大講義室 技術展示：1階展示スペース

10:30 開会挨拶

10:40-11:30 基調講演

東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター 矢代 航 教授

「微細加工の X 線・中性子イメージングへの応用」

11:30-12:30 休憩（近隣で昼食をとられる方へご案内 <https://goo.gl/maps/gasRnzTM5R18eZBRA>）

12:30-17:00 講演、技術展示

12:30-12:50 アメテック株式会社

12:50-13:10 パーク・システムズ・ジャパン株式会社

13:10-13:30 SIJ Technology, Inc.

13:30-14:10 ～ネットワークキングブレイク（技術展示見学）～

14:10-14:30 ミカサ株式会社

14:30-14:50 株式会社ティ・ディ・シー

14:50-15:10 住友精密工業株式会社

15:10-15:30 GenlSys 株式会社

15:30-15:50 ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社

16:00-16:50 展示会ブースツアー

16:50 閉会挨拶

9月8日(木) Hands-on Workshop -Basic- [西澤潤一記念研究センター](#)

レーザー描画装置、EB 描画装置、BEAMER、Zygo、膜厚測定機能付きスピコータ、サブフェムトイン

クジェット、AFM など、メーカーのご協力により 8 コースを用意しています。

10 時～17 時を 2 時間ごとに 3 つのセッションに分けていますので、最大 3 つのコースへの参加が可能です。

9 月 9 日(金) Hands-on Workshop -Advanced- [西澤潤一記念研究センター](#)

レーザー描画装置によるグレイスケール露光 (DOE、マイクロレンズアレイ)、EB 描画装置による BEAMER 補正パターンの露光

↓詳細はこちらをご覧ください

[Hands-on Workshop のプログラム 8 月 19 日現在\(PDF\)](#)

お申込み先：<https://forms.gle/2AjNVrqRoPp2jAPr8>

お問い合わせ先：[nmfs-office@mail.mu-sic.tohoku.ac.jp](mailto:nmfs-office@mail.mu-sic.tohoku.ac.jp)

.....  
東北大学マイクロシステム融合研究開発センター(μSIC)

戸津 健太郎

980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉 519—1176

Tel: 022-229-4113 Fax: 022-229-4116

Email: [totsu@tohoku.ac.jp](mailto:totsu@tohoku.ac.jp)

↓微細加工、MEMS などのデバイス開発にご利用ください。

試作コインランドリ HP <http://www.mu-sic.tohoku.ac.jp/coin/>